WO 2005/034252

10

15

20

25

PCT/EP2004/011360

Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung.

Licht emittierende Halbleitervorrichtungen stellen heutzutage Schlüsselkomponenten u.a. in Vorrichtungen zum Übertragen Information, in Speichervorrichtungen, in Anzeigevorrichtungen und in Beleuchtungsvorrichtungen dar.

Im sichtbaren Spektralbereich leuchtende Halbleitervorrichtungen stellen hingegen keine derart hohen Leuchtintensitäten zur Verfügung. So konnten die ersten Leuchtdioden (LEDs) gerade genug Intensität zur Verfügung stellen, um als Anzeigelemente in frühen Taschenrechnern und digitalen Uhren zum Einsatz zu kommen. Gegenwärtig besteht jedoch ein Trend, im sichtbaren Spektralbereich leuchtende LEDs auch in Bereichen einzusetzen, in denen eine hohe Lichtintensität gefordert wird. Beispielsweise versuchen Automobilhersteller, immer mehr herkömmliche Leuchtkörper im Auto durch LEDs zu ersetzen. Als ein weiteres Einsatzgebiet für LEDs mit hoher Lichtintensität bieten sich bspw. Ampeln an, in denen hoch intensiv leuchtende rote, grüne und gelbe Emitter gefragt sind. Aber nicht nur in der Verkehrs- und Fahrzeugtechnik, sondern auch in der Informationsübertragung sind LEDs, die im sichtbaren Spektralbereich eine hohe Lichtintensität zur Verfügung stellen, nutzbringend einzusetzen. Beispielsweise können im sichtbaren Spektralbereich hoch intensiv emittierende LEDs zur kurzreichweitigen Datenübertragung über Kunststofffasem Verwendung WO 2005/034252 PCT/EP2004/011360 2

finden. Im Gegensatz zu Glasfasern, bei denen die maximale Transmission, d.h. die maximale Durchlässigkeit für elektromagnetische Strahlung, im infraroten Spektralbereich liegt, liegt die maximale Transmission bei Kunststofffasern im grünen Spektralbereich, so dass für die Datenübertragung über Kunststofffasern insbesondere hoch intensiv grünes Licht emittierende LEDs von Interesse sind. Wichtig für die genannten Anwendungsgebiete sind dabei sowohl die Effizienz des Strahlungserzeugungsprozesses im Halbleitermaterial, da diese für die Intensität der abgegebenen Strahlung von Bedeutung ist, als auch die Wellenlänge der abgegebenen Strahlung.

10

15

20

25

30

Das elektrische Verhalten eines Halbleitermaterials lässt sich mit dem sog. Bändermodell beschreiben. Dieses besagt, dass den Ladungsträgern des Halbleitermaterials verschiede Energiebereiche, die sog. Energiebänder, zur Verfügung stehen, innerhalb derer sie im Wesentlichen beliebige Energiewerte annehmen können. Verschiedene Bänder sind häufig durch eine Bandlücke, d.h. einen Energiebereich mit Energiewerten, welche die Ladungsträger nicht annehmen können, voneinander getrennt. Wenn ein Ladungsträger von einem energetisch höher gelegenen Energieband in ein Energetisch niedriger gelegenes Energieband übergeht, wird eine Energie freigesetzt, die der Differenz aus den Energiewerten vor und nach dem Übergang entspricht. Die Differenzenergie kann dabei in Form von Lichtquanten (Photonen) freigesetzt werden. Man unterscheidet zwischen sog. direkten und indirekten Bandlücken. Bei einer indirekten Bandlücke müssen zwei Prozesse zusammentreffen, damit ein Übergang zwischen den Energiebändern unter Emission von Licht stattfinden kann. Daher weisen Halbleitermaterialien mit indirekten Bandlücken in der Regel eine viel geringere Effizienz beim Erzeugen von Licht auf, als Halbleitermaterialien mit sog, direkten Bandlücken, in denen zum Aussenden von Licht nur ein Prozess nötig ist.

Als Ladungsträger stehen in einem Halbleitermaterial negativ geladene Elektronen und positiv geladene Löcher, die man sich im Wesentlichen als "fehlende" Elektronen in einem Energieband vorstellen kann, zur Verfügung.

Ein Loch kann durch den Übergang eines Elektrons aus einem anderen Energieband in das Energieband, in dem das Loch vorliegt, aufgefüllt werden. Den Vorgang des Auffüllens nennt man Rekombination. Durch Einbringen von Fremdstoffen, sog. Dotierstoffen, in das Halbleitermaterial lässt sich ein Übergewicht an Elektronen oder Löchern als Ladungsträger erzeugen. Bei einem Übergewicht an Elektronen bezeichnet man das Halbleitermaterial als n-leitend bzw. n-dotiert, bei einem Übergewicht an Löchern als Ladungsträgern als p-leitend bzw. p-dotiert. Das Einbringen von Dotierstoffen kann darüber hinaus benutzt werden, die den Ladungsträgern zur Verfügung stehenden Energieniveaus im Halbleitermaterial zu beeinflussen.

5

10

15

20

25

30

Heutzutage basieren viele kommerziell erhältliche LEDs auf Gallium-Phosphid (GaP), das ein Halbleitermaterial mit einer indirekten Bandlücke ist. Einbringen von sog. tiefen Störstellen, die man sich vereinfacht als den Ladungsträgern zugängliche Energieniveaus außerhalb der Energiebänder des GaP vorstellen kann, ermöglicht die Herstellung von LEDs auf GaP-Basis. Aufgrund der indirekten Bandlücke Ist die Effizienz derartiger LEDs beim Erzeugen von Licht gering. Die tiefen Störstellen lassen sich erzeugen, indem Fremdatome wie etwa Stickstoffatome in geeigneter Weise in das GaP eingebracht werden.

LEDs, die auf GaP basieren, das mit Stickstoff (N) dotiert ist, d.h. in das Stickstoff als Dotierstoff eingebracht ist, emittieren in Abhängigkeit von der Menge an N, mit der es dotiert ist, im Spektralbereich von grün bis gelb.

LEDs, die auf GaP, welches mit Zinkoxid (ZnO) dotiert ist, basieren emittieren dagegen rotes Licht. Zwar weist mit ZnO dotiertes GaP im Vergleich zum mit N dotiertem GaP eine etwas höhere Effizienz beim Erzeugen von Licht auf, jedoch findet die Emission in einem spektralen Frequenzbereich statt, in dem das menschliche Auge relativ unempfindlich ist, so dass das emittierte Licht wenig hell erscheint. Zudem verringert sich die Effizienz des Lichterzeugungsprozesses im mit ZnO dotierten GaP mit zunehmendem Steuerstrom der LED.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Licht emittierende Halbleitervorrichtung zur Verfügung zu stellen, die insbesondere im sichtbaren Spektralbereich eine hohe Effizienz beim Emittieren von Licht aufweist.

5

10

15

20

25

30

Diese Aufgabe wird durch eine Licht emittierende Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche enthalten vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Eine erfindungsgemäße Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung umfasst einen ersten, einen zweiten und einen dritten, aktiven Hableiterbereich. Der erste und der zweite Halbleiterbereich können insbesondere jeweils Al_xGa_{1-x}P (Aluminium-Gallium-Phosphid) mit 0 ≤ x ≤ 1 umfassen. Während die Leitfähigkeit des ersten Halbleiterbereiches auf Ladungsträgern eines ersten Leitfähigkeitstyps beruht, beruht die Leitfähigkeit der zweiten Halbleiterbereiches auf Ladungsträgern eines zweiten Leitfähigkeitstyps, welche eine den Ladungsträgern des ersten Leitfähigkeitstyps entgegengesetzte Ladung aufweisen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Halbleiterbereich ist der aktive Halbleiterbereich angeordnet, welcher insbesondere $Al_xGa_{1-x}P$ mit $0 \le x \le 1$ umfassen kann, wobei in den aktiven Halbleiterbereich Quantenstrukturen eingebettet sind. die aus einem Halbleitermaterial hergestellt sind, das eine direkte Bandlücke aufweist. Dabei kann das Al_xGa_{1-x}P aller Halbleiterbereiche auch einen kleinen Anteil an Arsen (As) enthalten (bis zu ca. 50%), der hier nicht weiter erwähnt, ist aber von der Bezeichnung Al_xGa_{1-x}P mit umfasst sein soll.

Unter Quantenstrukturen sind dabei Strukturen zu verstehen, die in mindestens einer Ausdehnungsrichtung eine Abmessung aufweisen, die derart gering ist, dass die Eigenschaften der Struktur von quantenmechanischen Vorgängen wesentlich mitbestimmt werden. Als Quantenstrukturen kommen bspw. Quantenpunkte (Quantum Dots), in denen alle Ausdehnungsrichtungen geringe Abmessungen aufweisen, Quantendrähte (Quantum Wires), in denen zwei Ausdehnungsrichtungen geringe

WO 2005/034252 PCT/EP2004/011360 5

Abmessungen aufweisen, oder Quantenschichten (Quantum Wells), in denen eine Ausdehnungsrichtung geringe Abmessungen aufweist, in Frage.

Das Halbleitermaterial, aus dem die Quantenstrukturen hergestellt sind, kann insbesondere ein III-V-Halbleitermaterial, d.h. eine Verbindung aus Elementen der 3. und der 5. Gruppe des Periodensystems, sein, welches eine direkte Bandlücke und eine Gitterkonstante besitzt, die größer ist, als die von GaP. Dabei ist anzumerken, dass die Gitterkonstante von Al_xGa_{1-x}P nicht von x abhängt und im Wesentlichen denselben Wert wie GaP besitzt. Als III-V-Halbleitermaterial eignet sich bspw. InP (Indium-Phosphid), aber auch andere Verbindungen von Elementen der 3. Gruppe, wie etwa Indium (In), Gallium (Ga) oder Aluminium (Al) mit Elementen der 5. Gruppe, wie etwa Phosphor (P), Arsen (As) oder Antimon (Sb), sind grundsätzlich geeignet.

15

20

25

30

10

5

Mit der erfindungsgemäßen Halbleiterstruktur zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung lässt sich im sichtbaren Spektralbereich eine höhere Effizienz beim Emittieren von Licht erzielen, als mit Licht emittierenden Halbleiterstrukturen nach Stand der Technik. Der Grund hierfür ist folgender:

Die erfindungsgemäße Halbleitervorrichtung ermöglicht es im Gegensatz zu den auf GaP basierenden Licht emittierenden Halbleitervorrichtungen nach Stand der Technik, einen direkten Übergang zwischen zwei Energiebänden zum Emittieren von Licht im sichtbaren Spektralbereich zu nutzen. Der direkte Übergang erfolgt dabei in den eingebetteten Quantenstrukturen, also etwa im InP, welches eine direkte Bandlücke aufweist. Wie oben erwähnt, ist die Effizienz beim Emittieren von Licht bei einem direkten Übergang höher als bei einem indirekten Übergang, so dass die Effizienz der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung über der von Licht emittierenden Halbleitervorrichtungen nach Stand der Technik liegt.

Zudem kann beim Herstellen der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung teilweise auf die Technologie von auf GaP basierenden LEDs zurückgegriffen werden.

- In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Halbleiter-5 vorrichtung sind die Halbleiterbreiche in Form von Halbleiterschichten eines Schichtstapels realisiert. In diesem Fall lassen sich zum Herstellen der Halbeitervorrichtung aus der Halbleitertechnik bekannte Epitaxie-Verfahren nutzen. Unter Epitaxie-Verfahren sollen hierbei alle Verfahren zu verstehen sein, mit denen eine Schicht geordnet auf eine kristalline Unterlage auf-10 gebracht werden kann. Als Beispiele seinen die Molekularstrahlepitaxie (MBE, molecular beam epitaxy) und das Abscheiden aus der Gasphase (CVD, chemical vapour deposition) genannt. Mit dem Epitaxie-Verfahren ist das beim Herstellen von auf AlGalnP oder GaP basierenden LEDs zur Anwendung kommende Bonden von Wafern, also ein Verkleben von Wafern, 15 nicht nötig. Daher ist die Herstellung insbesondere von als LEDs ausgestalteten erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtungen gegenüber LEDs nach Stand der Technik vereinfacht. Zudem lässt sich das Epitaxie-Verfahren gut in bestehende Prozessabläufe zum Herstellen von Halbleitervor-20 richtungen integrieren. Außerdem kann durch die Anwendung der Epitaxie-Verfahren das Entstehen von Fehlstellen in den Halbleiterbereichen reduziert werden. Derartige Fehlstellen würden die Emissionseigenschaften der Halbleitervorrichtung negativ beeinflussen.
- Das Vorliegen eines direkten Übergangs ist in der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung insbesondere dann sichergestellt, wenn die Quantstrukturen eine laterale Ausdehnung, d.h. eine Ausdehnung senkrecht zur Stapelrichtung, besitzen, die im Durchschnitt weniger als ca. 50 nm beträgt. Insbesondere liegt die durchschnittliche laterale Ausdehnung der Quantenstrukturen im Bereich zwischen 10 und 30 nm.

Insbesondere, wenn die InP-Bedeckung mindestens 0,5 Monolagen (ML) beträgt, findet die Emission im sichtbaren Spektralbereich statt. Eine Monolage entspricht dabei einer Bedeckung, die bei gleichmäßigem

Verteilen des InP über die unter den Quantenstrukturen befindliche Schicht eine in Stapelrichtung einatomige InP-Schicht ergäbe. Insbesondere kann die InP-Bedeckung zwischen 0,5 ML und ca. 10 ML, vorzugsweise zwischen 0,5 und 8 ML, und insbesondere zwischen 0,5 ML und ca. 4 ML liegen. Durch die geeignete Wahl der Bedeckung innerhalb der angegebenen Grenzen kann die Farbe des emittierten Lichtes festgelegt werden.

5

10

15

20

25

30

In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung umfasst der aktive Halbleiterbereich mehrere Unterbereiche, die verschiedene InP-Bedeckungen aufweisen. Durch geeignete Wahl der jeweiligen Bedeckung der Unterbereiche kann eine Halbleitervorrichtung erzeugt werden, die quasi weißes Licht abgibt. Die Unterbereiche können dabei insbesondere als verschiedene Halbleiterschichten ausgebildet sein. Alternativ können sie sich stattdessen auch in ihrer lateralen Anordnung unterscheiden, so dass sie verschiedene Teilbereiche einer gemeinsamen Halbleiterschicht bilden.

Die erfindungsgemäße Halbleitervorrichtung kann insbesondere als Leuchtdiode, superlumineszente Diode oder Laserdiode ausgestaltet sein. Im Falle
der superlumineszenten Diode bzw. der Laserdiode bildet die erfindungsgemäße Halbleitervorrichtung den aktiven Bereich der superlumineszenten
Diode bzw. der Laserdiode sowie die unmittelbar angrenzenden Bereiche.
Superlumineszente Dioden und insbesondre Laserdioden lassen sich mit
Hilfe der aus dem Stand der Technik bekannten tiefen Störstellen nicht
realisieren.

Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vorteile der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen.

Fig. 1 zeigt schematisch einen die Erfindung realisierenden Schichtstapel.

Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus dem aktiven Halbleiterbereich der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung im Detail.

5

10

15

20

25

30

Fig. 1 stellt als ein Ausführungsbeispiel für die erfindungsgemäße Halbleitervorrichtung den Schichtstapel einer Leuchtdiode dar, welcher auf ein ndotiertes Substrat 1 aufgebracht ist. Der Schichtstapel umfasst eine ndotierte erste Halbleiterschicht 3, die einen ersten Halbleiterbereich bildet, und eine p-dotierte zweite Halbleiterschicht 5, die einen zweiten bildet. Die Elektronen der n-dotierten Halbleiterbereich ersten Halbleiterschicht 3 stellen dabei im vorliegenden Ausführungsbeispiel die Ladungsträger des ersten Leitfähigkeitstyps dar, wohingegen die Löcher der p-dotierten zweiten Halbleiterschicht 5 die Ladungsträger des zweiten Leitfähigkeitstyps darstellen. Zwischen der n-dotierten ersten Halbleiterschicht 3 und der p-dotierten zweiten Halbleiterschicht 5 sind drei undotierte Quantenstrukturschichten 7A - 7C angeordnet, die den aktiven Halbleiterbereich der LED bilden. Zwar sind die Quantenstrukturschichten 7A - 7C im vorliegenden Ausführungsbeispiel undotiert, jedoch können sie in alternativen Ausgestaltungen des Ausführungsbeispiels n-Dotierung oder eine p-Dotierung aufweisen. Schließlich befindet sich über der zweiten Halbleiterschicht 5 eine stark p-dotierte Kontaktschicht 9 zum elektrischen Kontaktieren der zweiten Halbleiterschicht 5.

Es sei angemerkt, dass die Dotierungen des Substrates 1, der ersten und zweiten Halbleiterschicht 3, 5 sowie der Kontaktschicht 9 auch umgekehrt sein können. Die erfindungsgemäße Halbleiterstruktur würde dann ein p-dotiertes Substrat, eine p-dotierte erste Halbleiterschicht 3, eine n-dotierte zweite Halbleiterschicht 5 sowie eine n-dotierte Kontaktschicht 9 aufweisen.

Die Schichtdicken sind in Fig.1 nicht maßstäblich dargestellt. Während die Halbleiterschicht 3 eine Dicke von 200 nm und die Halbleiterschicht 5 eine Dicke von 700 nm aufweisen, weisen die drei Quantenstrukturschichten 7A – 7C zusammen nur eine Dicke von etwa 9 nm und die Kontaktschicht 9 eine Schichtdicke von 10 nm auf.

9

PCT/EP2004/011360

Das Substrat 1, die erste Halbleiterschicht 3, die zweite Halbleiterschicht 5 sowie die Kontaktschicht 9 sind als dotierte GaP-Schichten ausgebildet. Als Dotierstoff enthalten das Substrat 1 und die erste Halbleiterschicht 3 jeweils Silizium (Si), wobei die Si-Konzentration in der ersten Halbleiterschicht 3 5x10¹⁷ cm⁻³ entspricht. Die zweite Halbleiterschicht 5 und die Kontaktschicht 9 enthalten hingegen Beryllium (Be) als Dotierstoff, und zwar in einer Konzentration von 5x10¹⁷ cm⁻³ (zweite Halbleiterschicht 5) bzw. 1x10¹⁹ cm⁻³ (Kontaktschicht 9).

Eine der Quantenstrukturschichten 7A – 7C ist in Fig. 2 im Detail dargestellt. Die Quantenstrukturschicht 7 umfasst eine GaP-Schicht 11, in die InP-Inseln 13 als Quantenpunkte (Quantum Dots) eingebettet sind. Die GaP-Schicht 11 wird gelegentlich auch als GaP-Matrix bezeichnet. Die InP-Inseln setzen auf einer sog. InP-Benetzungsschicht 15 (Wetting Layer) auf, welche die gesamte Oberfläche der unter der Quantenstrukturschicht 7 befindlichen Schicht bedeckt und eine Dicke zwischen 0,1 und 0,3 nm aufweist. Die Dicke der GaP-Schicht 11 ist derart gewählt, dass die InP-Inseln 13 noch mit GaP bedeckt sind, jedoch maximal mit ca. 1 nm GaP. Insgesamt beträgt die Dicke der in Fig. 2 dargestellten Quantenstrukturschicht 7 ca. 3 nm.

20

25

30

WO 2005/034252

Die lateralen Abmessungen der InP-Inseln 13 betragen im Durchschnitt maximal ca. 50 nm. Vorzugsweise liegt der Durchschnitt der lateralen Abmessungen im Bereich zwischen 10 und 30 nm, und die Bedeckung der unter der Quantenstrukturschicht 7 befindlichen Schicht durch das InP beträgt ca. 3,5 ML, d.h. das InP würde ausreichen, die darunter befindliche Schicht mit etwa 3,5 einatomigen InP-Lagen zu überziehen. Auf die Benetzungsschicht entfallen dabei ca. 1 ML des InP. Diese Bedeckung führt im vorliegenden Ausführungsbeispiel zur Emission von Licht mit einer Wellenlänge von ca. 600 nm. Durch Variieren der InP-Bedeckung lassen sich Leuchtdioden realisieren, die Licht im Spektralbereich zwischen orange und grün abgeben.

Bei einer Bedeckung von ca. 1,8 ML oder weniger liegen keine InP-Inseln mehr vor. Stattdessen bildet das InP eine gleichmäßige Schicht, so dass

man statt Quantenpunkten eine Quantenschicht erhält. Wenn im vorliegenden Ausführungsbeispiel von Quantenpunkten die Rede ist, sollen darunter auch Bedeckungen unter 1,8 ML zu verstehen sein, ohne dass ausdrücklich auf Quantenschichten statt auf Quantenpunkte Bezug genommen wird.

5

10

15

20

25

30

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind drei Quantenstrukturschichten 7A – 7C zwischen der ersten und der zweiten Halbleiterschicht 3, 5 angeordnet. Es genügt jedoch, wenn eine derartige Quantenstrukturschicht 7 vorhanden ist. Andererseits können aber auch mehr als nur drei Quantenstrukturschichten vorhanden sein. Vorzugsweise sind drei bis fünf Quantenstrukturschichten vorhanden.

Zusammen mit den Quantenstrukturschichten 7A - 7C bilden die erste und die zweite Halbleiterschicht 3, 5 eine Leuchtdiode. In dieser treten bei einer zwischen der Kontaktschicht 9 und dem Substrat 1 geeignet angelegten und im Allgemeinen als Durchlassspannung bezeichneten Spannung Elektronen aus der ersten Halbleiterschicht 3 und Löcher aus der zweiten Halbleiterschicht 5 in die Quantenstrukturschichten 7A - 7C ein. In den Quantenstrukturschichten 7A - 7C findet eine Rekombination von Elektronen und Löchern statt, d.h. Elektronen füllen die Löcher auf. Diese Rekombination stellt für die Elektronen ein Übergang von einem energetisch höher gelegenen Energieband in ein energetisch tiefer liegendes Energieband dar. Der Übergang ist dabei ein direkter Übergang, der im Wesentlichen in den Quantenpunkten, d.h. im InP, stattfindet. Aufgrund der geringen Abmessungen der InP-Quantenpunkte ist die Bandlücke im InP viel größer als in einem großvolumigen InP-Material, so dass die Wellenlänge des beim direkten Übergang emittierten Lichtes im sichtbaren Spektralbereich liegt. Da die Bandlücke in den InP-Quantenpunkten, d.h. der energetische Mindestabstand zwischen den beiden Bändern, und damit die Wellenlänge des emittierten Lichtes, von der InP-Bedeckung abhängt, kann durch die geeignete Wahl der InP-Bedeckung die Farbe des emittierten Lichtes im Bereich von orange bis grün variiert werden.

Zwar sind im beschrieben Ausführungsbeispiel das Substrat 1, die erste Halbleiterschicht 3, die zweite Halbleiterschicht 5 sowie die Kontaktschicht 9 als GaP-Schichten beschrieben, jedoch können diese Schichten allgemein als $Al_xGa_{1-x}P$ -Schichten mit $0 \le x \le 1$ ausgebildet sein, wobei die Werte für x von Schicht zu Schicht unterschiedlich sein können. Entsprechend brauchen die Quantenstrukturen nicht aus InP hergestellt zu sein. Stattdessen können sie als $In_yGa_{1-y}P$ -Schichten mit $0 \le y \le 0,5$, vorzugsweise mit $0 \le y \le 0,1$, ausgebildet sein. Da $Al_xGa_{1-x}P$ im sichtbaren Spektralbereich transparent ist, kann die beschriebene Schichtstruktur insbesondere auch dazu verwendet werden, vertikal, d.h. in Stapelrichtung, emittierende LEDs zu herzustellen.

Mit Hilfe geeigneter Maßnahmen zum Einschließen des emittierten Lichtes im aktiven Bereich der Halbleitervorrichtung, bspw. durch geeignete Wahl der Brechungsindices der einzelnen Schichten, bzw. durch das Vorsehen von Facetten an der Halbleiterstruktur können mit der erfindungsgemäßen Halbleitervorrichtung inkohärentes Licht aussendende superlumineszente Dioden oder kohärentes Licht aussendende Laserdioden hergestellt werden. Die grundsätzliche Struktur von superlumineszenten Dioden und Laserdioden ist bspw. den Büchern "Spontaneous Emission and Laser Oscillation in Microcavities", Edit. by Hiroyuki Yokoyama, and Kikuo Ujihara, CRC Press (1995)" und "Optoelectronics: An Introduction to Material and Devices", Jasprit Singh, The McGraw-Hill Companies, Inc., (1996)" zu entnehmen, auf die bezüglich der weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen superlumineszenten Diode und der erfindungsgemäßen Laserdiode verwiesen wird.

1. Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung mit

<u>Patentansprüche</u>

- einem ersten Hableiterbereich (3), dessen Leitfähigkeit auf Ladungsträgern eines ersten Leitfähigkeitstyps beruht,
 - einem zweiten Halbleiterbereich (5), dessen Leitfähigkeit auf den Ladungsträgern eines zweiten Leitfähigkeitstyps, welche eine den Ladungsträgern des ersten Leitfähigkeitstyps entgegengesetzte Ladung besitzen, beruht, und
 - einem zwischen dem ersten Halbleiterbereich (3) und dem zweiten Halbleiterbreich (5) angeordneten aktiven Halbleiterbereich (7A – 7C), in den Quantenstrukturen (13) eines Halbleitermaterials mit direkter Bandlücke eingebettet sind.

15

20

10

- Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, bei der erste Hableiterbereich (3), der zweite Halbleiterbereich (5) und der aktive Halbleiterbereich (7A 7C) jeweils Al_xGa_{1-x}P mit 0 ≤ x ≤ 1 umfassen und die Quantenstrukturen (13) aus einem III-V-Halbleitermaterial hergestellt sind, das eine Gitterkonstante besitzt, die größer ist, als die von GaP.
- 3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, bei der das III-V-Halbleitermaterial InP umfasst.
- 25 4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei der die Halbleiterbreiche in Form von Halbleiterschichten (3, 5, 7A 7C) eines Schichtstapels realisiert sind.
- 5. Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die Quantenstrukturen (13) eine laterale Ausdehnung besitzen, die im Durchschnitt weniger als ca. 50 nm beträgt.

- 6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, bei der die durchschnittliche laterale Ausdehnung der Quantenstrukturen (13) im Bereich zwischen 10 und 30 nm liegt.
- 5 7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3 und einem der Ansprüche 4 bis 6, bei der die InP-Bedeckung mindestens 0,5 ML beträgt.
- 8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der aktive Halbleiterbereich (7a 7c) mehrere Unterbereiche umfasst,
 10 die verschiedene InP-Bedeckungen aufweisen.
 - Leuchtdiode mit einer Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprüche
 bis 8.
- 15 10. Superlumineszente Diode mit einer Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8.
 - 11. Laserdiode mit einer Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

20

25

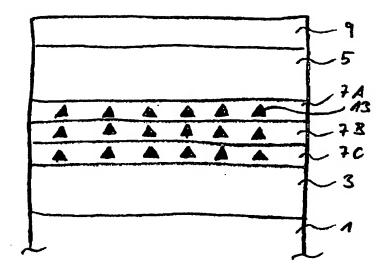
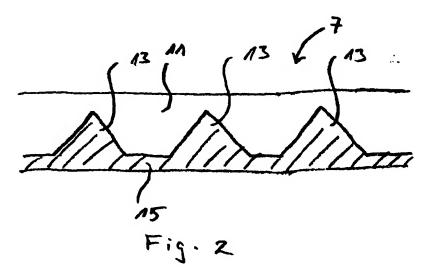


Fig. 1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intertiguonal Application No
PCT/EP2004/011360

			101/212004/011					
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L33/00							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS	SEARCHED							
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification $H01L$	ion symbols)						
	tion searched other than minimum documentation to the extent that o							
ŀ	ata base consulted during the international search (name of data be ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC	se and, where practical	, search terms used)					
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	levant passages	R	elevant to claim No.				
х	US 2002/136932 A1 (YOSHIDA SEIKO 26 September 2002 (2002-09-26)	H)	1	,4,9-11				
A	paragraph '0043! - paragraph '012 figures 1-15	2	2,3,5-8					
Υ	US 2003/170927 A1 (HOLONYAK NICK 11 September 2003 (2003-09-11)	1	.–7					
Α	paragraph '0034! - paragraph '0055!; claim 8-11 39; figures 5-8							
		-/						
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family i	members are listed in annex.					
Special ca	ategories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not	or priority date an	d not in conflict with the appl	lication but				
"E" earlier o	"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance considered to be of particular relevance considered to be of particular relevance; the claimed invention filling date considered novel or cannot be considered to							
"I." docume which citation	"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "L" document which is step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the							
O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means O' document is combined with one or more other such documents.				erson skilled				
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				1				
	4 June 2005	23/06/2	2005					
Name and r	mailing address of the ISA	Authorized officer						
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Vacues	1					
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Krause,	U					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermenal Application No	
PCT/EP2004/011360	

10	PACH PACHMENTS CONCIDEDED TO BE SELECTION.	PC1/EP2004/011360
Category *	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Jaleyory .	Challott of Occinions, with indealion, where appropriate, of the relevant pessages	ABIOVAIT TO CIGAR NO.
Y	HATAMI F ET AL: "Radiative recombination from InP quantum dots on (100) GaP" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 78, no. 15, 9 April 2001 (2001-04-09), pages 2163-2165, XP012027714 ISSN: 0003-6951 abstract page 2163, column 1, paragraph 1 - column 2, paragraph 2	1-7
A	WALTER G ET AL: "Room-temperature continuous photopumped laser operation of coupled InP quantum dot and InGaP quantum well InP–InGaP–In(AlGa)P&nd ash;InAlP heterostructures" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 79, no. 13, 24 September 2001 (2001-09-24), pages 1956-1958, XP012028957 ISSN: 0003-6951 the whole document	1-11
A ·	"Highly efficient band-edge emission from InP quantum dots" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 68, no. 22, 27 May 1996 (1996-05-27), pages 3150-3152, XP012015393 ISSN: 0003-6951 the whole document	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/011360

Patent document cited in search report		Publication date	_	Patent family member(s)	Publication date
US 2002136932	A1	26-09-2002	JP	2003017741 A	17-01-2003
US 2003170927	A1	11-09-2003	US US US CA CN EP JP WO	2003059998 A 2004209416 A 2004173789 A 2455230 A 1555570 A 1419519 A 2004537854 T 03012834 A	11 21-10-2004 11 09-09-2004 11 13-02-2003 15-12-2004 11 19-05-2004 16-12-2004

INTERNATIONAL ER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

IIVI	ERNATIONALER RECHERCHENE	PERIONI	PCT/EP200	4/011360	
A KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L33/00		-		
2710 7	11012337 00				
N		III			
	ternationalen Patentklasstiikation (IPK) oder nach der nationalen Kla RCHIERTE GEBIETE	issitikation und der IPK	· · ·		
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	ole)			
IPK 7	HO1L				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Hecherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recher	chlerten Gebiete	fallen	
Während de	r Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (f	Name der Datenbank und e	vtl. verwendete S	Suchbegriffe)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC				
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommend	en Teile	Betr. Anspruch Nr.	
х	US 2002/136932 A1 (YOSHIDA SEIKO	4)		1,4,9-11	
A	26. September 2002 (2002-09-26) Absatz '0043! - Absatz '0129!; Ab	obildungen		2,3,5-8	
	1–15	·		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Υ	US 2003/170927 A1 (HOLONYAK NICK	ET AL)		1-7	
	11. September 2003 (2003-09-11)			0.11	
Α	Absatz '0034! - Absatz '0055!; Ar 39; Abbildungen 5-8	ispruch		8-11	
	-	,			
1	_/				
			,		
			ĺ		
	·		ĺ		
			:		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Pat	entfamilie		
	ondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der				
aber ni "E" älteres [aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Ammeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist				
	Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung von besond				
andere	scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden vor Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die begesterte Edination				
ausgef	ausgeführt) Sterik aufter und eine die nicht auf die nicht ausgen der				
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beansnuchten Prindstradaum veröffentlichten worden ist "8" Veröffentlichung, die Witglied derselben Patentfamilie ist					
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des inte			
		•			
14	1. Juni 2005	23/06/200	5		
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bedie	nsteter		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Krause, J			
	Fax: (+31-70) 340-3016	niause, o			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/011360

		101/2020	04/011360
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	HATAMI F ET AL: "Radiative recombination from InP quantum dots on (100) GaP" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 78, Nr. 15, 9. April 2001 (2001-04-09), Seiten 2163-2165, XP012027714 ISSN: 0003-6951 Zusammenfassung Seite 2163, Spalte 1, Absatz 1 - Spalte 2, Absatz 2		1-7
A	WALTER G ET AL: "Room-temperature continuous photopumped laser operation of coupled InP quantum dot and InGaP quantum well InP–InGaP–In(AlGa)P&nd ash;InAlP heterostructures" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 79, Nr. 13, 24. September 2001 (2001-09-24), Seiten 1956-1958, XP012028957 ISSN: 0003-6951 das ganze Dokument		1-11
A	"Highly efficient band-edge emission from InP quantum dots" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 68, Nr. 22, 27. Mai 1996 (1996-05-27), Seiten 3150-3152, XP012015393 ISSN: 0003-6951 das ganze Dokument		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internsechales Aktenzelchen
PCT/EP2004/011360

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Daturn der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002136932 A	1 26-09-2002	JP	2003017741 A	17-01-2003
US 2003170927 A	1 11-09-2003	US US US CA CN EP JP	2003059998 A1 2004209416 A1 2004173789 A1 2455230 A1 1555570 A 1419519 A1 2004537854 T 03012834 A1	27-03-2003 21-10-2004 09-09-2004 13-02-2003 15-12-2004 19-05-2004 16-12-2004 13-02-2003

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADEÐ-TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
ATHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.